



معرفی و توسعه سنسور نیروی مغناطیسی نرم نوین براساس اثر هال

حسین میرزانژاد^۱، اشکان فتحیان^۲، محمد مجرّبی تبریزی^۳، محمد مهدی عاقلی حاجی‌آبادی^{*۴}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی ساخت و تویید، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳- استادیار، بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران

۴- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

* تهران، صندوق پستی 14115-146 agheli@modares.ac.ir

چکیده

مقاله پیش رو به ارائه یک سنسور نیروی نرم با صرفه اقتصادی بالا، مناسب برای کاربردهای ریاتیک نرم که مستلزم انعطاف‌پذیری بالا و گستره اندازه‌گیری وسیع به صورت نقطه‌ای و ممچین سطحی می‌پردازد. همه سنسورهای نیرویی که با سنسور اثر هال تاکنون ساخته شده‌اند، با اندازه‌گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک تکه آهن‌ربای جامد در نزدیکی سنسور اثر هال به سنجش نیروهای اعمالی می‌پردازند. سنسور نیرویی معرفی شده در این مطالعه با اندازه‌گیری تغییرات چگالی شار مغناطیسی حاصل از پودر مغناطیسی مخلوط شده با سیلیکون رابر، هنگامی که تحت فشار حاصل از نیروی عمودی قرار می‌گیرد، به نیروستنجی می‌پردازد. سنسور در ابعاد و با غلظت‌های متفاوت پودر مغناطیسی طراحی و ساخته شده است تا به یک طراحتی بهینه از نقطه‌نظر حساسیت در کنار خواص خطی قابل قبول منجر شود. بررسی نتایج حاصل از آزمون‌های تجربی نشان می‌دهد که با تنظیم خواص فیزیکی و ویژگی‌های ساختاری سنسور می‌توان به گستره‌های کاری مختلف با حساسیت‌های معین دست پیدا کرد. این سازگاری و انتطاق بالا در کنار اعتمادپذیری قابل قبول در بسیاری از اجزای اندازه‌گیر نیروی نرم در کاربردهای امروزی به خصوص در زمینه ریاتیک نرم مورد نیاز است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: 20 فوریه 1396

پذیرش: 15 خرداد 1396

ارائه در سایت: 08 تیر 1396

کلید واژگان:

سنسور نرم

رباتیک نرم

سنسور نیرو

اثر هال

Developing a novel soft magnetic force sensor based on Hall Effect

Hossein Mirzanejad¹, Ashkan Fathian¹, Mohammad Mojarrabi Tabrizi¹, Ali Sharifnejad², Mohammad Mahdi Agheli Haji Abadi^{1*}

1- Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2- Sport Science Research Institute, Centre of Sport Biomechanics, Tehran, Iran

* P.O.B. 14115-146 Tehran, Iran, agheli@modares.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 09 April 2017

Accepted 05 June 2017

Available Online 29 June 2017

Keywords:

Soft Sensor

Soft Robotics

Force Sensor

Hall Effect

ABSTRACT

This paper proposes a new inexpensive soft force sensor suitable for soft robotics applications that require high flexibility and wide range of sensing area. All Hall Effect sensors developed so far use a Hall Effect sensor to detect the magnetic field of a piece of solid magnet. The proposed force sensor in this paper uses a Hall Effect sensor to detect the magnetic flux density change induced by aligned magnetic powder blended with silicone rubber when a normal force is applied. The sensor is designed and tested with different magnetic powder density and sensor dimensions to achieve an optimum design in sensitivity as well as linearity. The experimental results show that different force measurement range with specific desired sensitivity can be achieved by adjusting certain physical properties of the sensor. This is a useful feature for many soft sensing elements in today's applications requiring more compliance and reliable sensors, especially in soft robotics applications.

نیز تولید ارزان باشند. امروزه شکل‌پذیری بالای الاستomerها مانند سیلیکون را در^۱ در کنار سایر ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها چون خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب و به کارگیری راحت و ارزان سبب استفاده گسترده این مواد به عنوان زمینه نرم در ساختار حسگرها و محرك‌های نرم شده است.

نحوه اندازه‌گیری مؤلفه‌های نیروهای مختلف اعمالی یکی از مهم‌ترین مباحث در حسگرها و محرك‌های نرم است. در حال حاضر از روش‌ها و مفاهیم مختلفی مانند استفاده از سنسورهای نیروی خازنی، مواد

¹ Silicon rubber

توسعه و بهبود سنسورها و عملگرهای نرم یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. زمینه‌های کاربردی زیادی از جمله توسعه رباتیک نرم [۱]، حسگرهای لمسی [۲]، زیست پزشکی [۳] و اندازه‌گیری حرکات مختلف بدن [۴] می‌توان نام برد که موجب علاقه پژوهشگران و سوق به مطالعه در این زمینه می‌شود. به دلیل طبیعت تجهیزات نرم، اجزای حسکننده باید دارای نرمی و انعطاف‌پذیری مطلوب علاوه بر ویژگی‌های مورد انتظار مانند دقت، اعتمادپذیری، خطی بودن و

است. در این ساختار در هر واحد سنجش نیرو نیازمند جای‌گذاری دقیق آهنرباهای دائمی منفرد در مقابل سنسور اثر هال است. در بسیاری از کاربردهای حس لمسی نیازمند حس توزیع نیروهای وارد در یک سطح گسترده به جای حس نقطه‌ای است و در بسیاری از کاربردها این سطح لزوماً یک سطح مسطح نیست. برای ساخت سنسورهای مناسب در این موارد که براساس اثر هال عمل می‌کنند، جای‌گذاری تعداد بسیار زیادی آهنربای دائمی کوچک در مقابل سنسور اثر هال به طور مناسب برای تشکیل یک رشته از واحدهای حس‌کننده نیاز است. برای چنین سیستمی دو اشکال اصلی مطرح است: ۱- وجود تعداد زیادی قطعات جامد در ساختار که برای کاربردهای نرم چندان مطلوب نیست. ۲- ایجاد یک سیستم غیرمجمع‌آشایی تکه‌های جدای از هم.

در این مقاله برای رفع این نواقص در یک سیستم نیروسنجدی براساس اثر هال به معرفی یک روش جدید برای ایجاد میدان مغناطیسی حول سنسور اثر هال با استفاده از پودر مغناطیسی به جای قطعات آهنربا پرداخته می‌شود. شکل ۱ شماتیکی از این سنسور جدید بدون به کارگیری آهنربای جامد نمودیموی در ساختار آن را نشان می‌دهد. تولید میدان مغناطیسی حول سنسور اثر هال توسط لایه‌ای از پودر مغناطیسی جهت‌گیری شده بالای سنسور هال صورت می‌پذیرد. در این مقاله طراحی، ساخت و بررسی خصوصیات این سنسور جدید ارائه شده است.

این مطالعه بر آن است که مقاهمیم و نیز روند ساخت سنسور در بخش ۲ ارائه شود. روش‌ها و طرحی آزمون در بخش ۳ و نتایج حاصل از آزمایش‌های عملی و نمودارهای مربوط در بخش ۴ آورده شده و مورد بحث و بررسی قرار

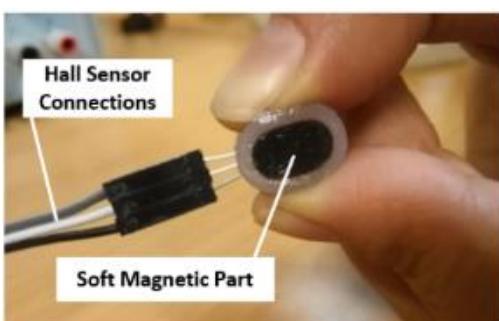


Fig. 1 The prototype of soft force sensor employing magnetic aligned powder to make field around a linear hall effect sensor

شکل ۱ نمونه سنسور نیروی نرم مورد مطالعه با انعطاف‌پذیری بالا که از پودر مغناطیسی جهت‌گیری شده برای ایجاد تغییرات میدان مغناطیسی حول سنسور اثر هال بهره می‌برد.

پیزوالکتریک، سنسورهای مقاومتی و بسیاری دیگر برای این منظور بهره برده می‌شود. هر یک از این موارد مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد [6,5]. برای نمونه استفاده از لایه‌های خانی [8,7] برای سنجش نیرو یک راه مؤثر برای داشتن سنسورهایی با خدمت بسیار کم، اما ساخت آن‌ها نیازمند بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته فناوری میکرو است. خواص غیرخطی نسبی از دیگر اشکالات این نوع سنسورهای است.

سنسورهای نیرویی پیزوورزیستیو [9] که جاسازی آن‌ها در خواص مشابه سنسورهای خازنی دارند و نیازمند پیاده‌سازی روی بردۀای مدار چاپی جامد است، ساختارهای انعطاف‌پذیر و انتناردار را با مشکل مواجه می‌کند. صلبیت نامطلوب حسگرها برای کاربردهای نرم با جاسازی کاتال‌های میکروسیال در زمینه سیلیکونی سنسورهای ارائه شده در مراجع [10-12] تا حدی برطرف شده است. نمونه‌های با قابلیت تغییر شکل زیاد این نوع سنسورها برای کاربردهای با کرنش بالا مانند لباس‌های هوشمند مناسب، ولی در اینجا نیز برای ساخت دقیق میکروکاتال‌ها نیاز به روش‌های تولید به نسبت پیچیده است.

گاهی در کاربردهای رباتیک نرم نیاز به اندازه‌گیری نیروهای گستردۀ سطحی است. بدین منظور از رشته واحدهای حس‌کننده استفاده می‌شود که معمولاً با ایجاد مسیرهای ارباطی و سیم‌کشی‌های پرترکم در ساختار شبکه مورد نظر می‌شود. لیف‌پی [13] و همکاران از بارومترهای MEMS در یک ساختار آرایه‌ای به جای سنسورهای پیزوورزیستیو و صفحات خازنی برای سنجش نیروهای گستردۀ صفحه‌ای استفاده کردند. این ایده با وجود ساختار ساده و کاربردی به دلیل وجود بارومترهای صلب و حجیم در ساختار خود ممکن است برای کاربردهای با انعطاف‌پذیری بالا و نیز دارای محدودیت‌های ضخامتی گزینه مناسبی نباشد.

رفتار غیرخطی، ساختار حجیم و فرایند تولید پیچیده و هزینه‌بر برقی از ویژگی‌های نامطلوب سنسورهای یادشده است. با استفاده از سنسورهای مغناطیسی به کمک سنسورهای اثر هال می‌توان بر این مشکلات چیره شد. این سنسورهای مغناطیسی در عین سادگی و ارزانی ساخت به دلیل تغییرات خطی خروجی سنسور اثر هال در اثر تغییرات میدان حول آن می‌تواند با اختصار برقی از این سنسورهای نیروی نرم گزارش شده که براساس اثر هال مؤلفه‌های نیرو را شناسایی و اندازه‌گیری می‌کنند و به همراه کاربردها و ویژگی‌های خاص هر کدام نشان داده شده است.

در تمام این سنسورهای نیروی مغناطیسی یک قطعه آهنربای دائمی کوچک داخل یک پوشش نرم غالباً از جنس سیلیکون رابر جاسازی شده

جدول ۱ تعدادی از مهم‌ترین کارهای صورت گرفته بر اندازه‌گیری نیرو براساس اثر هال طی سال‌های مختلف

Table 1 Some of major works on force sensing based on hall effect over the years

سال	کاربرد	ابعاد مورد سنجش	ویژگی‌ها
1992	استفاده در دست مصنوعی ماهر (بازوی ربات) [14]	یکبعدی (نیروی عمودی)	طراحی ساده و ارزان، حساسیت پایین برای نیروهای بررشی
2006	سنسورهای نوک اگشتن ربات انسان‌نمایی موسوم به جیمز [15]	یکبعدی (نیروی عمودی)	گستره کاری پایین (نیروهای کم)، رفتار غیرخطی
2013	مفهوم اندازه‌گیری نیرو در سه بعد با سنسور اثر هال [16]	سه‌بعدی	رفتار خطی، حساسیت پایین برای نیروهای بررشی
2013	سنسورهای لمسی برای سکوهای رباتیک حساس [17]	سه‌بعدی	رفتار غیرخطی برای برقی از بارگذاری‌ها، مدل‌سازی المان محدود
2015	نیروسنجدی در جراحی بدون آسیب و در اعاده ریز [3]	یکبعدی (نیروی عمودی)	گستره کاری پایین (نیروهای کم)، رفتار خطی
2015	کاربردهای زیست‌پزشکی [18]	سه‌بعدی	پاسخ خطی برای نیروهای عمودی
2016	کاربردهای زیست‌پزشکی [19]	سه‌بعدی	پسماند نسبی، مدل‌سازی ریاضی

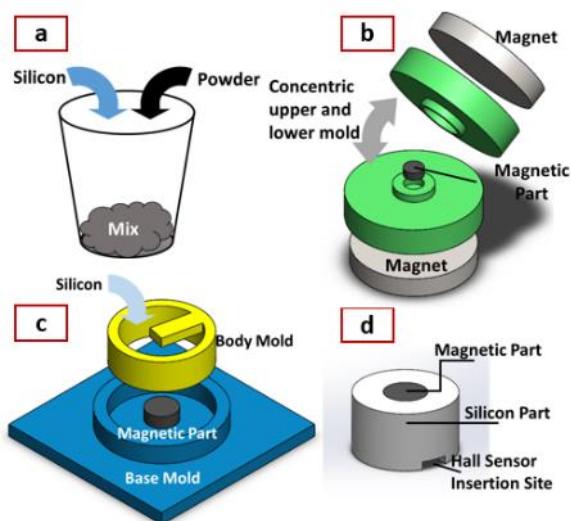


Fig. 3 The fabrication steps of the soft sensor: a- Mixing magnetic powder with silicon, b- Powder alignment with a pair of magnets, c- Molding soft silicon body, d- The fabricated soft sensor.

شکل 3 مراحل ساخت سنسور نرم: الف- محلولت کردن پودر مغناطیسی با سیلیکون رابر، ب- جهت‌گیری دوقطبی‌های پودر مغناطیسی توسط میدان خارجی، ج- قالب‌بریزی بدن نرم سیلیکونی، د- سنسور نرم تولید شده

حاصل تعییه شده است (شکل ۳-د).

دلیل به کار بردن یک جفت آهنربای استوانه‌ای جهت‌دهی دوقطبی‌های مغناطیسی در ساختار مخلوط پودر و سیلیکون در یک جهت خاص (عمودی) است. در حالی که میدان مغناطیسی در اطراف یک آهنربای استوانه‌ای دارای بزرگی و جهت‌های متفاوتی است، قرار دادن دو آهنربای استوانه‌ای روبروی هم به صورت هم‌مرکز (مطابق شکل ۴) می‌تواند منجر به ایجاد ناحیه‌ای در فضای بین آن‌ها شود که در آن بزرگی و جهت میدان مغناطیسی به طور قابل قبولی یکنواخت است. این ناحیه روبروی خط تحت عنوان cutline در شکل 4 قرار دارد. آهنرباهای نئودیومی برای ایجاد میدانی با قدرت مناسب انتخاب شده‌اند. قطر این آهنرباهای بزرگ انتخاب شده‌اند تا بتوان از تأثیر تغییرات شدید میدان در لبه‌های آن اجتناب کرد. در اینجا بیشینه قطر بخش مغناطیسی سیلیکون (مخلوط استوانه‌ای شکل سیلیکون و پودر) ۱۲ میلی‌متر است.

قطر آهنرباهای استوانه‌ای تولید میدان ۳۰ میلی‌متر انتخاب شده است تا

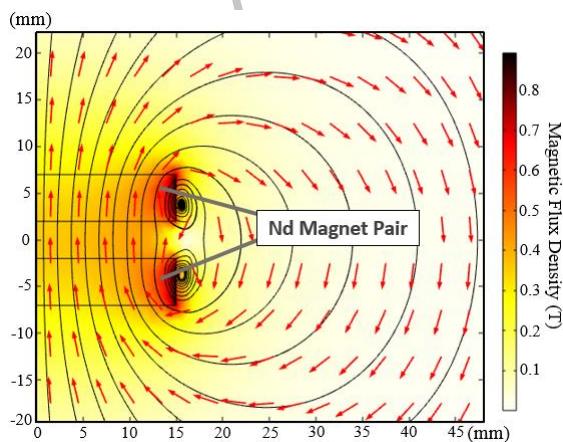


Fig. 4 نمایش خطوط میدان در اطراف یک جفت آهنربای دائمی نئودیومی

گرفته است. در بخش ۵ به جمع‌بندی موضوع پرداخته خواهد شد.

2- سنسور

2-1- مفاهیم

سنسور نیروی ارائه شده در این مقاله از یک سنسور اثر هال برای اندازه‌گیری تغییرات چگالی شار مغناطیسی (B) به هنگام اعمال نیروی عمودی بهره می‌گیرد. سنسور به شکل استوانه‌ای و با خواص فیزیکی مختلف شامل قطر ناحیه مغناطیسی (D)، ارتفاع بدن نرم (h) و غلظت پودر مغناطیسی به کار رفته در ساختار آن ساخته شده است. در ادامه همین بخش به توضیح بیشتر این خواص پرداخته خواهد شد. سنسور اثر هال خطی در وجه مسطح پایینی بدن نرم استوانه‌ای جاسازی شده به صورتی که قسمت حسگر جلو سنسور رو به بالا قرار گرفته است. در وجه بالایی سنسور مخلوطی همگن از پودر و سیلیکون رابر به صورت لایه‌ای با ضخامت معین قرار گرفته است. دوقطبی‌های ذرات پودر مغناطیسی توسط اعمال میدان مغناطیسی خارجی در حین قالب‌بریزی به صورت عمودی (از بالا به پایین) جهت‌گیری شده‌اند؛ بنابراین می‌توانند مانند یک آهنربای دائمی در تزدیکی سنسور اثر هال مانند شکل 2 عمل کنند. بدن نرم سنسور از جنس سیلیکون رابر است. هنگام اعمال نیروی عمودی فشاری، بدن نرم سیلیکونی سنسور متألف با بزرگی نیروی وارد فشرده شده و بدین‌سان سبب تغییر فاصله ناحیه مغناطیسی نسبت به سنسور اثر هال و تغییرات لاثراخروجی آن می‌شود.

2- ساخت سنسور

بدنه نرم سنسور مورد نظر از سیلیکون رابر با قابلیت پخت در دمای اتاق با نام تجاری آرتیوی ۴۴۰۳ محصول شرکت پی.سی.سی ساخته شده است که بعد از پخت سیلیکونی با سفتی در حدود ۱۰ در مقیاس شور A با ظاهر بی‌رنگ نیمه شفاف به دست می‌دهد. شکل استوانه‌ای سنسور از قالب‌گیری سیلیکون در قالب‌های پلاستیکی از جنس پی-ال-ای که توسط پرینتر سه‌بعدی ساخته شده به دست آمده است. ساختار کلی سنسور طی دو مرحله برای تولید دو بخش مختلف آن قالب‌گیری شده است: بخش بالایی یا بخش مغناطیسی و بخش پایینی یا بخش ارتاجاعی. مراحل مختلف تولید این سنسور دو بخشی به ترتیب در شکل ۳ نشان داده شده است. مطابق شکل ابتدا لایه نازکی از مخلوط همگن با نسبت معین پودر مغناطیسی و سیلیکون رابر (شکل ۳-ا) در حضور میدان مغناطیسی ناشی از یک جفت آهنربای دائمی (شکل ۳-ب) قالب‌گیری شده است. پس از پخت مخلوط در دمای اتاق به مدت تقریبی ۱۵ ساعت، لایه مغناطیسی نرم ایجاد شده در مرکز قالب پایه مانند شکل ۳-c قرار داده و قالب بدن سنسور بر آن سوار می‌شود تا سیلیکون رابر خالص داخل آن ریخته شود، پس از پخت مجدد نمونه نهایی آماده گردد. یک شیار باریک برای جاسازی سنسور اثر هال در بدن سیلیکونی نمونه

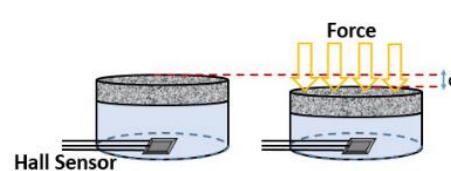


Fig. 2 Applying normal force from above, compresses the soft cylinder and causes the magnetic part (dark region) get closer to the hall sensor.

شکل ۲ اعمال نیروی عمودی از بالا، بدن استوانه‌ای نرم سنسور را فشرده ساخته و سبب تزدیکتر شدن ناحیه مغناطیسی (ناحیه تیره) به سنسور اثر هال می‌شود.

3-2-ست آب آزمایش

مطابق مطالعی که در بخش پیشین توضیح داده شد، تعداد سه پارامتر هر یک در سه سطح در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به تعداد 27 نمونه باید از سنسورها ساخته شده و مورد آزمایش قرار گیرند تا نتایج به جامع ترین شکل ممکن حاصل شوند. همه سنسورها به شکل استوانه‌ای با قطر کلی یکسان 12 میلی‌متر مشابه آن‌چه در شکل 6 نشان داده تهیه شده است. در این شکل (شکل 6) همه نمونه‌های دارای غلظت پودر یکسان در بخش مغناطیسی ولی در ابعاد مختلف (قطر ناحیه مغناطیسی و ارتفاع سنسور) نشان داده شده‌اند. هر سنسور می‌تواند با اختصاص یک کد به آن که شامل مقادیر هر سه پارامتر فیزیکی مورد بررسی در ساختار آن است، به طور منحصر به فرد نام‌گذاری شود. برای نمونه کد D8-h5-1:2 به نمونه‌ای با قطر ناحیه مغناطیسی 8 میلی‌متر، ارتفاع کل 5 میلی‌متر و درنهایت غلظت پودر ناحیه مغناطیسی با نسبت ترکیب جرمی 1 به 2 (یک سهم پودر، دو سهم سیلیکون) اشاره دارد. این نام‌گذاری در ادامه مقاله به کار خواهد رفت. ست آب آزمایش‌ها همان‌طور که در شکل 7 نشان داده شده است، شامل یک منبع تغذیه مگاتک ام پی-3005 دی، یک مولتی‌متر (سینومتر دی-ام ۹۷) برای خواندن ولتاژ خروجی سنسور اثر هال (اس-اس 49 ای هانیول) با دقت یک میلی ولت و یک مکانیزم اعمال نیرو که برای اعمال نیروهای فشاری مختلف به صورت پله به سنسورهای مورد آزمایش طراحی شده است. خروجی سنسور اثر هال در حالت غیربارگذاری شده که آن را ولتاژ آفست می‌نامیم، در حدود 2.4 ولت به ازای ولتاژ تغذیه 5.0 ولت است. هنگامی که بدنه سنسور نرم موردنظر تحت اثر نیروی فشاری وارد از سمت مکانیزم اعمال نیرو فشرده می‌شود (میزان فشرده‌گی سنسورها توسط ساعت اندازه‌گیری مطابق شکل 8 بدست آمده است)، ولتاژ خروجی سنسور اثر هال از مقدار اولیه آن (ولتاژ آفست) شروع به تغییر می‌کند که پاسخ عمومی یک نمونه از سنسورها در شکل 9 آورده شده است. نتایج خالص این آزمایش برای همه 27 نمونه ساخته شده از سنسورها بدون تقویت‌شوندگی در شکل 10 آورده شده است.

4-بحث و نتیجه‌گیری

نمونه‌های شرح داده شده در بخش 3 با اعمال نیروی عمودی از بالای هر کدام مورد آزمایش قرار گرفته و ولتاژهای خروجی آن‌ها ثبت شد. مشاهدات حاکی از آن است که هر سنسور مغناطیسی جدای از مقدار پارامترهای دخیل در ساختار آن (یعنی D و h) یک رویه و رفتار یکسانی مانند آن‌چه در

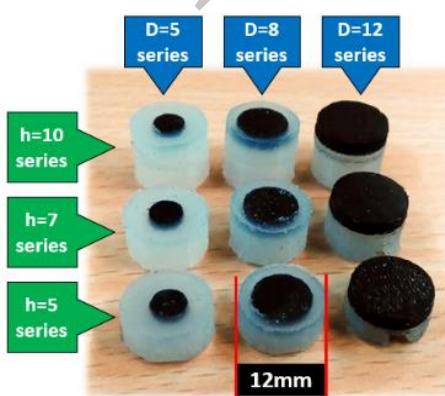


Fig. 6 All 9 prototypes with different D and h but the same MR

شکل 6 همه نمونه‌های با D و h مختلف و غلظت پودر یکسان

یکنواختی یادشده حاصل شود. قدرت میدان بین دو آهن ربا با تغییر فاصله آن‌ها نسبت به هم (z) تغییر می‌یابد. شکل 5 تغییرات میدان بین یک جفت آهن ربا نشود بیومی استوانه‌ای با قطر و ارتفاع به ترتیب 5 و 30 میلی‌متر به ازای چندین فاصله مختلف آن‌ها از هم که در نرمافزار المان محدود کامسول مولتی‌فیزیکس 5.1 شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد. برای هدف مورد نظر در آزمایش‌ها فاصله بین دو آهن ربا (z) برابر 4 میلی‌متر در نظر گرفته شده است. مطابق شکل 5 در این فاصله قدرت زیاد میدان ضمن حفظ یکنواختی آن تضمین می‌شود.

3-آزمایش‌های عملی

1-3-روش‌های آزمایش

در این مطالعه تأثیر متغیرهای مختلف بر رفتار خروجی سنسور ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تحت بررسی شامل غلظت پودر مغناطیسی یا همان نسبت ترکیب پودر و سیلیکون (MR)، قطر ناحیه مغناطیسی (D) و ارتفاع کل سنسور استوانه‌ای (h) است که در ادامه به شرح هر کدام می‌پردازیم.

الف) غلظت پودر

اثر غلظت پودر ترکیب شده با سیلیکون برای تشکیل ناحیه مغناطیسی سنسور مورد نظر بدین گونه بررسی شده است که سه نسبت ترکیب جرمی مختلف (که به اختصار با MR نشان می‌دهیم) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند: 1:5، 1:2 و 1:1. (نسبت ترکیب 1:n یعنی یک سهم جرمی از پودر با n سهم جرمی از سیلیکون ترکیب شده است).

ب) قطر ناحیه مغناطیسی

قطر لایه نازک استوانه‌ای موسوم به بخش مغناطیسی سنسور نیز در سه سطح تغییر داده شده است تا اثر این تغییرات بر خروجی سنسور مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی دارای اهمیت بالای از نظر پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیا داشتن ناحیه مغناطیسی وسیع تر بهتر است یا خیر. بدین منظور سه قطر 5 و 12 میلی‌متر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، همچنین ارتفاع همه این لایه‌های مغناطیسی استوانه‌ای 2 میلی‌متر است.

ج) ارتفاع سنسور

سه سطح مختلف 5، 7 و 11 میلی‌متر برای ارتفاع کل سنسور مورد مطالعه قرار گرفت.

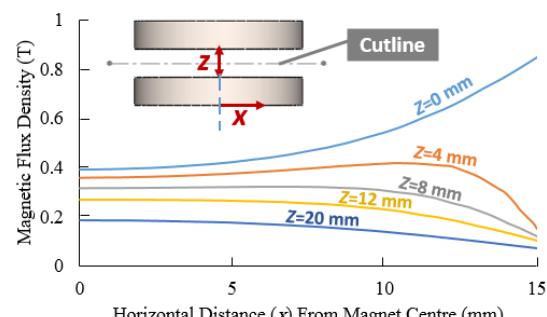


Fig. 5 Magnetic flux magnitude change for different distances between two cylindrical magnets

شکل 5 تغییرات بزرگی چگالی شار مغناطیسی به ازای فاصله‌های مختلف بین دو آهن ربا استوانه‌ای

قرار دارد) و درنهایت با افزایش فشردگی در اثر اعمال نیروهای بزرگتر خروجی سنسور کاهش می‌یابد (محدوده فرود). پاسخ همه 27 سنسور ساخته شده تحت این آزمایش به صورت دسته‌بندی شده در شکل 10 به نمایش گذاشته شده است. تأثیر هر یک از پارامترهای مورد بررسی در ادامه جداگانه بحث شده است.

الف) اثر تغییر در غلطت پودر

براساس شکل 10 افزایش نسبت ترکیب (MR) پودر مغناطیسی در سیلیکون سبب افزایش حساسیت در پاسخ سنسور شده و موجب شیب بیشتر پاسخ هم در ناحیه صعود و هم در ناحیه فرو رود می شود.

ب) اثر تغییر در قطر ناحیه مغناطیسی

تأثیر اساسی قطر ناحیه مغناطیسی به صورتی است که هر چه قطر ناحیه مغناطیسی کوچک‌تر باشد، ورود پاسخ سنسور به محدوده فرود به تأخیر خواهد افتاد. به عبارت دیگر نمونه‌های با قطر ناحیه مغناطیسی کمتر دارای گستره سنجش نبی‌وی، وسیع‌تری با شیب مثبت (محدوده صعود) است.

ج) اثر تغییر در ارتفاع سنسور

ارتفاع کل سنسور تأثیر قابل توجهی بر حساسیت (شیب) پاسخ و نیز بیشینه گستره نیرویی قابل سنجش در محدوده صعود دارد. نمونه‌های نازکتر (سنسورهای با ارتفاع کمتر) حساس‌تر از نمونه‌های بلندتر است، ولی پهنای محدوده صعود در این نمونه‌ها به شدت کاهش می‌یابد و پاسخ زودتر وارد ناحیه فرود می‌شود. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سنسورهای با خامات ناچیز می‌توانند به طور کلی در ناحیه فرود آن‌ها برای اندازه‌گیری نیرو به کار روند و افزایش جزئی پاسخ در ابتدای اندازه‌گیری شان صرف نظر کرد. با توجه به بحث‌های بالا بسته به ویژگی مورد انتظار از سنسور نرم، ممکن است انتخاب نمونه‌ای با یک D , h و MR مشخص مناسب در نظر گرفته شود. برای نمونه در اندازه‌گیری‌های گستره پایین و با حساسیت نسبی بیشتر نمونه‌هایی با ناحیه مغناطیسی غلیظتر (حاوی سهم بیشتری از پودر)، ناحیه مغناطیسی کوچکتر (D کوچکتر) و بدنه ضخیم‌تر (h بیشتر) مانند $D5-h10-1:1$ مطلوب است. برای کاربردهای متفاوت دیگری مانند اندازه‌گیری نیروهای عمودی نواحی مختلف کف پا بر یک کفی کفش (شکل 11) که بیشتر با نیروهایی در مقیاس بزرگ‌تر سروکار داشته و از طرفی سنجش مؤلفه‌های نیرو باید در ناحیه‌ای نسبتاً نازک انجام گیرد، استفاده از سنسورهای نرم با ارتفاع کم (مثل سری $D5$) معمول‌تر خواهد بود که این نمونه‌ها همان‌طور که پیشتر دیدیم، تقریباً در محدوده فرود و با گستره نیرویی به نسبت بالایی با شیب ثابت عمل می‌کنند. با توجه به شکل 8 می‌توان تغییر ارتفاع (ضخامت) سنسورها در اثر نیروهای مختلف را مشاهده کرد. در این نمودار با توجه به جایه‌جایی برابر نمونه‌های هم ارتفاع، جایه‌جایی میانگین نمونه‌های با ارتفاع برابر آورده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود چنان‌چه عملکرد سنسور در ناحیه صعودی مطلوب باشد، نمونه‌های با ارتفاع بیشتر و به طبع آن با قابلیت جایه‌جایی زیادتر ناحیه مغناطیسی نسبت به سنسور اثر هال برای این استفاده موفق‌تر خواهند بود. برای نمونه با در نظر گرفتن نمونه‌های سری $D5$ در شکل 10 و توجه به جایه‌جایی‌های متناظر نیروهای وارده در شکل 8 مشاهده می‌شود که حد نهایی سنجش نیرو در محدوده با شیب مثبت برای نمونه‌های با ارتفاع ۱۰، ۷ و ۵ میلی‌متر به ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۹ نیوتون است که مرتباً گفت نمونه‌های با ارتفاع بیشتر که

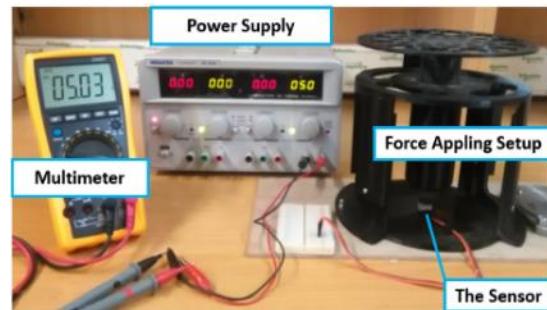


Fig. 7 Experimental set-up

شکل 7 ستاب آزمایش

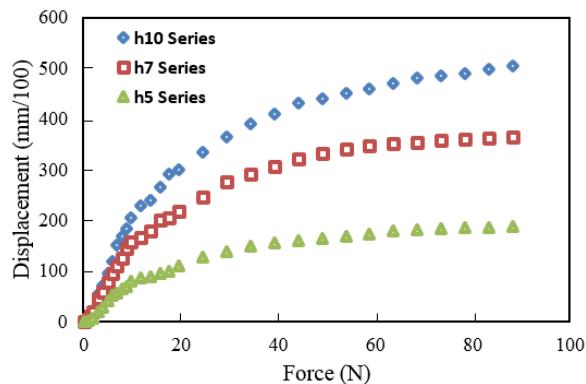


Fig. 8 The measured displacement of the sensors for different forces
کل 8 جایه‌جایی‌های اندازه‌گیری شده سنسورها به ازای نیروهای مختلف

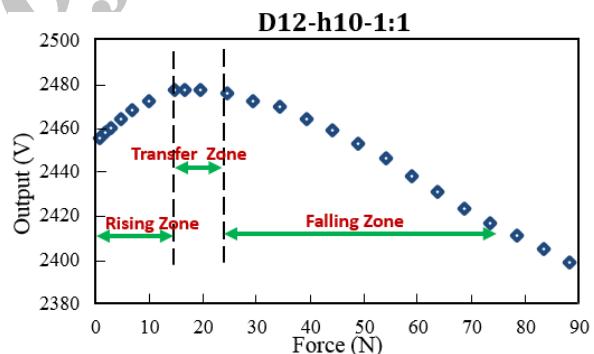


Fig. 9 Typical response of the soft sensor

شکل ۹ پاسخ عمومی یک نمونه از سنسور مورد مطالعه

شکل 9 به نمایش گذاشته شده از خود نشان می‌دهد. نمودار آورده شده در این شکل پاسخ متناظر با نمونه 1:1-h10-D12 است.

تمام سنسورها به گونه‌ای ساخته شده که سطح بالایی لایه مغناطیسی مانند قطب شمال و سطح پایینی آن مانند قطب جنوب یک آهن‌ربا عمل کند. از طرفی رفتار سنسور اثر هال خطی تعییه شده در زیر این لایه مغناطیسی به گونه‌ای است که ولتاژ خروجی آن به هنگام نزدیکتر شدن قطب شمال یک آهن‌ربا کاهش و هنگام نزدیک شدن قطب جنوب آهن‌ربا افزایش می‌یابد. پاسخ مورد انتظار از سنسور طراحی شده با این خصوصیات می‌تواند افزایش پیوسته ولتاژ خروجی در اثر اعمال نیروی فشاری بدان باشد. با این وجود پاسخ واقعی سنسورها مطابق آن‌چه در شکل 9 نشان داده شده، به گونه‌ای است که ولتاژ خروجی سنسور با افزایش تدریجی فشار وارد ابتدا افزایش می‌یابد (که در شکل 9 با عنوان محدوده صعود مشخص شده است)، سپس وارد ناحیه کوچک گذار شده (که بینینه ولتاژ خروجی در این ناحیه

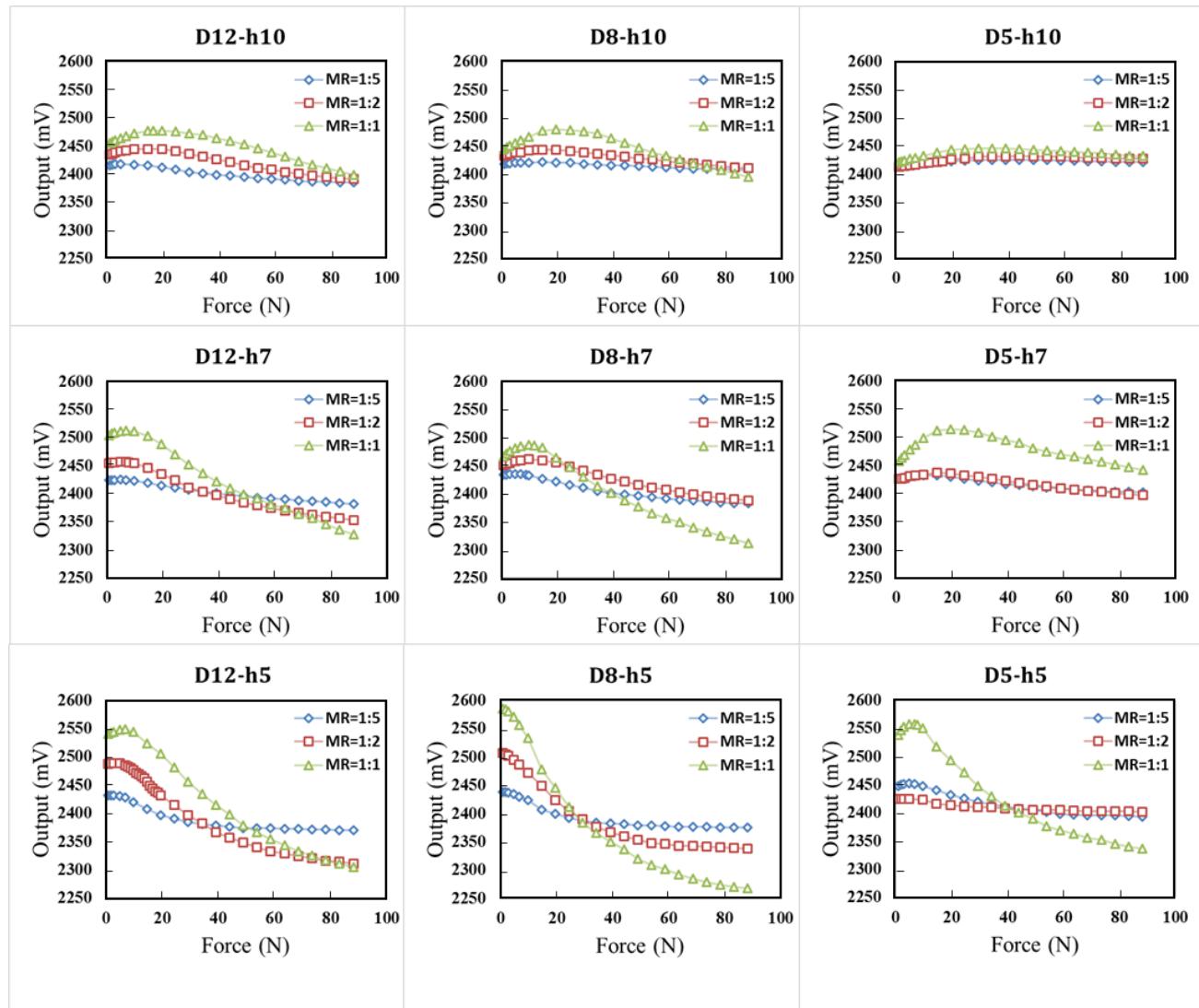


Fig. 10 Output voltage of soft sensor prototypes versus applied normal forces

شکل 10 خروجی ولتاژ نمونه سنسورهای نرم به ازای نیروهای فشاری مختلف اعمالی به آنها

فیزیکی بر خواص نهایی و پاسخ به دست آمده از سنسور به صورت آزمایش عملی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تغییر در هر یک از پارامترهای فیزیکی تأثیر ویژه‌ای در رفتار سنسور یعنی حساسیت و گستره کاری (حد اشباع سنسور) دارد. مطالعات نشان داد که این سنسور می‌تواند به عنوان یک گزینه کارآمد برای کاربردهای مختلف سنجش نیرو در زمینه‌های ریاتیک نرم و حسگرهای لمسی که نیازمند سنسورهای انعطاف‌پذیر، ساده و کم هزینه در نظر گرفته شود. استفاده از پودر مغناطیسی نسبت به آهن رای

امکان تغییر ارتفاع در آن‌ها بیشتر است در گستره نیروی وسیع تری پاسخ صعودی دارد. برای نمونه در سری D5 جایه‌گایی تا حد نهایی گستره صعودی برای نمونه h10 3.5 میلی‌متر و برای نمونه h5 تنها در حدود 0.5 میلی‌متر است.

در بررسی دلیل اساسی تفاوت رفتار سنسور در نیروهای بالا و پایین فرضیه‌هایی را می‌توان پایه‌گذاری کرد. یکی از این فرضیه‌ها غالبه اثر قطب دورتر به سنسور هال تحت نیروهای زیاد (فسرددگی بیشتر) و دیگری پیچش جزئی لبه‌های سنسور نرم و بیشتر شدن حالت به اصطلاح بشکه‌ای آن در اثر افزایش فشار وارد بر آن است که این پیچش و تغییر زاویه لبه‌های سنسور از حالت صاف ممکن است موجب تغییر در قطب مغناطیسی برایند در مقابل سنسور اثر هال شود. هر چند توجیه اخیر معقول‌تر به نظر می‌آید برای پاسخ قطعی باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

5- جمع‌بندی و کارهای آینده

در این مقاله یک سنسور نیروی نرم براساس اثر هال معرفی شد که در ساختار آن از پودر مغناطیسی به جای آهن رای جامد استفاده شد. فرایند طراحی و ساخت این سنسور شرح داده شد و تأثیر پارامترهای مختلف



Fig. 11 A smart sensing insole engaging all-around magnetic layer

شکل 11 یک کفی کفش هوشمند که از یک لایه مغناطیسی سرتاسری بهره می‌برد

- Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 37th Annual International Conference of the IEEE, Milan, Italy, pp. 7970-7973, Aug 25, 2015.*
- [4] J. H. Low, P. M. Khin, C. H. Yeow, A Pressure-Redistributing Insole using Soft Sensors and Actuator, *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* Washington State Convention Center Seattle, Washington, May 26-30, 2015.
- [5] M. I. Tiwana, S. J. Redmond, N. H. Lovell, A review of tactile sensing technologies with applications in biomedical engineering, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 179, pp. 17-31, 2012.
- [6] Z. Kappassov, J. A. Corrales, V. Perdereau, Tactile sensing in dexterous robot hands — Review, *Robotics and Autonomous Systems*, Vol. 74, pp. 195–220, Dec 31, 2015.
- [7] M. Y. Cheng, C. L. Lin, Y. T. Lai, Y. J. Yang, A Polymer-Based Capacitive Sensing Array for Normal and Shear Force Measurement, *Sensors*, Vol. 10, pp. 10211-10225, 2010.
- [8] L. Viry, A. Levi , M. Totaro , A. Mondini et al, Flexible Three-Axial Force Sensor for Soft and Highly Sensitive Artificial Touch, *Advanced Materials*, Vol. 26, No. 17, pp. 2610-2610, May, 2014.
- [9] L. Beccai, S. Roccella, A. Arena, F. Valvo et al, Design and fabrication of a hybrid silicon three-axial force sensor for biomechanical applications, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 120, pp. 370-382, 2005.
- [10] D. M. Vogt, Y. L. Park, R. J. Wood, Design and characterization of a soft multi-axis force sensor using embedded microfluidic channel, *IEEE Sensors Journal*, Vol. 13, No. 10, October, 2013.
- [11] J. T. Muth , D. M. Vogt , R. L. Truby , Y. Menguc et al, Embedded 3D Printing of Strain Sensors within Highly Stretchable Elastomers, *Advanced Materials*, Vol. 26, No. 36, pp. 6307-6312, Sep , 2014.
- [12] E. L. White, J. C. Case, R. K. Kramer, Multi-mode strain and curvature sensors for soft robotic applications, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 253, pp. 188–197, 2017.
- [13] L. P. Jentoft, Y. Tenzer, D. Vogt, J. Liu et al, Flexible, stretchable tactile arrays from mems barometers, *IEEE 16th International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, Karlsruhe, Germany, Nov 25, 2013.
- [14] P. J. Kyberdt, P. H. Chappel, A force sensor for automatic manipulation based on the Hall effect, *Measurement Science and Technology*, Vol. 4, No. 3, pp. 281-287, 1993.
- [15] L. Jamone, G. Metta, F. Nori, G. Sandini, James: A Humanoid Robot Acting over an Unstructured World, *6th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, Genova, Italy, Dec 4, 2006.
- [16] C. Ledermann, S. Wirges, D. Oertel, M. Mende et al, Tactile Sensor on a Magnetic Basis using novel 3D Hall sensor- First prototypes and results, *IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems*, Costa Rica, Jun 19-21, 2013.
- [17] S. Youssefian, N. Rahba, E. Torres-Jara, Contact behavior of soft spherical tactile sensors, *IEEE Sensors Journal*, Vol. 14, No. 5, pp. 1435-1442, May, 2014.
- [18] D. S. Chathuranga, Z. Wang, Y. Noh, T. Nanayakkara et al, Disposable soft 3 axis force sensor for biomedical applications, *37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, Milan, Italy, Aug, 2015.
- [19] D. S. Chathuranga, Z. Wang, Y. Noh, T. Nanayakkara et al, Magnetic and mechanical modeling of a soft three-axis force sensor, *IEEE Sensors Journal*, Vol. 16, No. 13, July 1, 2016.

جامد از مزایایی بخودار است. برای نمونه با استفاده از پودر می‌توان لایه‌های مغناطیسی نرم و انعطاف‌پذیری ساخت که به هر شکل دلخواه پیوسته و با هر انحنایی مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان یک بررسی موردنی این ایده در اندازه‌گیری نیروهای نیروهای کف پا که باید توسط یک کف کشش هوشمند انجام گیرد، بسیار مفید خواهد بود. ایده مورد نظر که در واقع کار آینده نویسنده‌گان، به صورت مفهومی در شکل 11 نشان داده شده است. علاوه‌بر این کارهای آتی شامل تلاش‌هایی برای بررسی و بهبود خواص این سنسور با در نظر گرفتن سایر پارامترها مثل تأثیر سفتی سنسور در عملکرد آن خواهد بود. سایر ویژگی‌های سنسور مورد نظر مانند پسماند و پاسخ دینامیکی آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

6- فهرست عالیم

چگالی شار مغناطیسی (T)	B
قطر بخش مغناطیسی (mm)	D
ارتفاع کل سنسور (mm)	h
نسبت ترکیب پودر با سیلیکون	MR
فاصله افقی از مرکز آهنربا (mm)	x
فاصله بین دو آهنربای استوانه‌ای (mm)	z

7- تقدیر و تشکر

این پژوهه طی قرارداد شماره 11/7482 از طرف پژوهشگاه تربیت بدنی پشتیبانی مالی شده است که بدین‌وسیله از پژوهشگاه تربیت بدنی تقدیر و تشکر می‌شود.

8- مراجع

- [1] S. Ozel, N. A. Keskin, D. Khea, C. D. Onal, A precise embedded curvature sensor module for soft-bodied robots, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 236, pp. 349-356, 2015.
- [2] H. J. Kwon, J. H. Kim, W. C. Choi, Development of a flexible three-axial tactile sensor array for a robotic finger, *Microsyst Technol*, Vol.17, No. 12, pp. 1721-1726, 2011.
- [3] G. Chatzipirpiridis, P. Erne, O. Ergeneman, S. Pané, B. J. Nelson, A magnetic force sensor on a catheter tip for minimally invasive surgery,